Cu基板上薄膜残留物の分析

J&J&J&J&J&J&J&J&J&J&J&

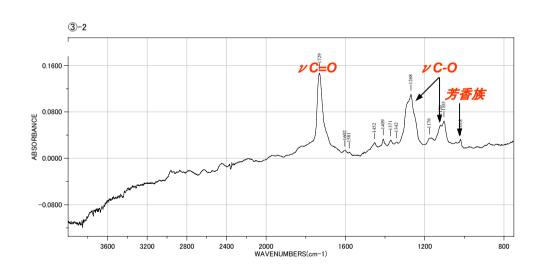
<分析手法>FT-IR

Cu基板上の薄膜残留物が何かを調べるため、 顕微FT-IR(フーリエ変換-赤外分光)高感度反射法を 用いて、分析を実施しました。

<結果>

薄膜残留物(厚み: $0.5 \mu m程度)$ はPET*であり、基板表面フィルム由来であることが判明しました。

* PET: ポリエチレンテレフタレート



Cu 基板上の薄膜残留物の 赤外吸収スペクトル

連絡先:菱電化成㈱ 分析センター;(06)6497-7544